



제 29회 한국반도체학술대회

The 29th Korean Conference on Semiconductors

2022년 1월 24일(월)~ 26일(수) | 강원도 하이원 그랜드호텔(컨벤션타워)

2022년 1월 25일(화), 09:00-10:30

Room J (하트 III, 6층)

B. Patterning 분과

[TJ1-B] 포토리소그래피 I

좌장: 이진균 교수(인하대학교), 김명웅 교수(인하대학교)

<p>TJ1-B-1 09:00-09:30</p>	<p>극자외선 노광 공정, 소재 개발을 위한 평가 기술과 인프라 이상설 포항가속기연구소, 포항공과대학교</p>
<p>TJ1-B-2 09:30-10:00</p>	<p>Quantum Manipulated Metal Oxo Cluster Networks for EUV Resist Hyun-Dam Jeong Department of Chemistry, Chonnam National University</p>
<p>TJ1-B-3 10:00-10:15</p>	<p>Line-Edge Roughness from Extreme Ultraviolet Lithography to Fin-Field-Effect-Transistor: Computational Study Sang-Kon Kim The Faculty of Liberal Arts, Hongik University</p>
<p>TJ1-B-4 10:15-10:30</p>	<p>Machine Learning을 활용한 SRAF Printing 예측 Modeling 기술 개발 Sung Ho Kim, Jin Ho Yang, Sung Woo Ko, and Cheol Kyun Kim SK Hynix</p>